

# Точечные квантовые контакты в разупорядоченных Si-МОП структурах с инверсионным $p$ -каналом: нелинейное поведение системы в продольном и поперечном электрическом поле

© А.С. Веденеев<sup>¶</sup>, М.А. Феклисов

Институт радиотехники и электроники Российской академии наук,  
141190 Фрязино, Россия

(Получена 1 августа 2005 г. Принята к печати 13 января 2006 г.)

В условиях перколяционного перехода диэлектрик–металл обсуждается поведение латеральной проводимости  $G$  мезоскопических Si-МОП структур с инверсионным  $p$ -каналом, обладающих высокой концентрацией встроенных (ионных) зарядов ( $N_t \leq 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ ). При температурах  $\geq 77 \text{ К}$  на зависимостях  $G$  от поперечного ( $V_g$ ) и продольного ( $V_d$ ) напряжений обнаружены: квазиплато  $G(V_g)$  при  $G \approx 2e^2/h$  и минимум  $G(V_d)$  при  $|V_d| < 0.1 \text{ В}$  ( $G \ll e^2/h$ ). Демонстрируется соответствие данных, полученных из эффекта поля, результатам расчета характеристик точечного квантового контакта (параметры кривизны потенциала в продольном и поперечном направлениях  $\hbar\omega_x \approx \hbar\omega_y \approx 10 \text{ мэВ}$ ) и порядковое отличие  $\hbar\omega_x \approx 300 \text{ мэВ}$ , определенного из зависимости  $G(V_d)$ . Отличие связывается с нелинейностью системы квантовых контактов по отношению к продольному и поперечному электрическому полю. Показано, что число квантовых контактов на пути протекания изменяется под действием поля в диапазоне  $1 \leq N \leq 30$ .

PACS: 73.40.Qv, 73.23.-b

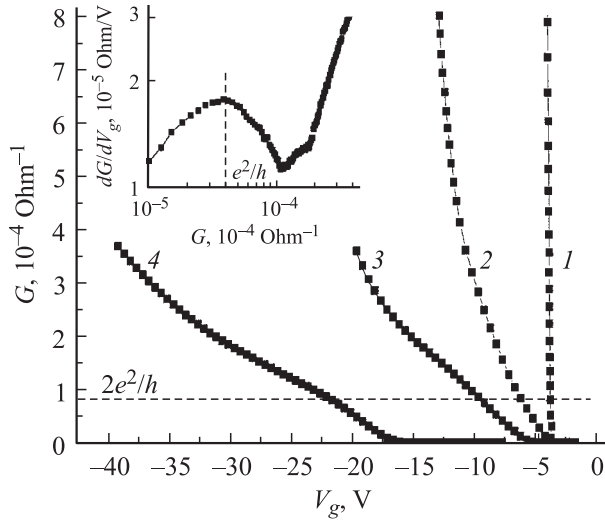
Практические структуры металл–диэлектрик–полупроводник (МДП) обычно разупорядочены вследствие повышенного содержания встроенных (примесных) зарядов, индуцирующих флуктуационный потенциал (ФП) границы раздела полупроводник–диэлектрик. В современных транзисторных структурах, например НЕМТ [1], концентрация встроенных зарядов  $N_t \geq 10^{12} \text{ см}^{-2}$ , а амплитуда ФП  $\Delta = (e^2/\kappa)\sqrt{\pi N_t} \geq 20 \text{ мэВ}$  [2] превышает  $kT$  уже при азотных температурах ( $e$  — заряд электрона,  $\kappa$  — средняя диэлектрическая проницаемость границы полупроводника с диэлектриком,  $T$  — температура,  $k$  — постоянная Больцмана). В условиях сильного ФП латеральная проводимость структуры  $G$  осуществляется за счет перехода носителей заряда между ямами хаотического потенциального рельефа через седловые области ФП. Характерные размеры таких областей определяются нижним пределом пространственного масштаба флуктуаций и при  $N_t \geq 10^{12} \text{ см}^{-2}$  соизмеримы с длиной волны носителей. В этих условиях перевальные области ФП выступают как точечные квантовые контакты [3,4], а проводимость структуры в свою очередь приобретает квантовый характер  $e^2/h$ . Данные области, хаотически распределенные по энергии в интервале  $\Delta$ , характеризуются широким спектром флуктуаций локального сопротивления, что обуславливает перколяционный режим электронного переноса [5]. Соответственно образцам с длиной, соизмеримой с радиусом корреляции перколяционного кластера  $L_c$ , присущи явления некогерентной мезоскопии [4,6]. Перенос заряда в них осуществляется по малому числу аномально низкоомных путей протекания и контролируется критическими (наиболее высокоомными) участками таких путей — одиночными квантовыми контактами. Такая ситуация, недавно реали-

зованная нами в разупорядоченных Si-МНОП структурах (металл–нитрид–окисел–полупроводник) [7,8], интересна тем, что допускает количественный анализ характеристик квантовых контактов, образуемых седловыми областями ФП. В настоящей работе исследуется поведение системы квантовых контактов в поперечном (эффект поля) и продольном электрических полях на примере разупорядоченных Si-МОП структур (металл–окисел–полупроводник) с инверсионным  $p$ -каналом.

В качестве объектов исследования выбраны модельные Si-МОП структуры (длина полевого электрода в направлении тока  $L = 10 \text{ мкм}$ , толщина затворного слоя  $\text{SiO}_2$   $d = 200 \text{ нм}$ ), изготовленные на слабо легированном  $n$ -Si (КЭФ10) ориентации (100) по HCl-технологии [9]. Образцы, изготовленные по этой технологии, содержат ионные заряды, наиболее подвижные из которых — ионы  $\text{Na}^+$  [10]. Подвижные ионы позволяют создавать встроенные заряды вблизи границы раздела Si– $\text{SiO}_2$  с концентрацией  $N_t \sim 10^{13} \text{ см}^{-2}$  [11,12], являющиеся источниками сильного ФП [2]. В нашем случае смещение ионов к границе Si– $\text{SiO}_2$  достигалось путем термополевого воздействия [9]. Образцы нагревались до  $250^\circ\text{C}$  и выдерживались при этой температуре при напряжении полевого электрода  $\leq +40 \text{ В}$  в течение заданного времени (до 300 мин). Величина  $N_t$ , задаваемая в диапазоне  $10^{11} - 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$  временем выдержки образцов и напряжением полевого электрода, контролировалась по смещению напряжения порога кривых эффекта поля [11].

По модуляционной методике измерялась дифференциальная проводимость  $G = dI/dV_d$  ( $I$  — сила тока в канале) в зависимости от потенциала полевого электрода  $V_g$  и продольного напряжения  $V_d$ . На рис. 1 приведены зависимости  $G(V_g)$ , измеренные при  $V_d \approx 1 \text{ мВ}$  и  $T = 77 \text{ К}$

<sup>¶</sup> E-mail: asv335@mail.ru



**Рис. 1.** Зависимость проводимости от поперечного напряжения в режиме эффекта поля при  $T = 77$  К для исходного состояния образца (1) и  $N_t = 6 \cdot 10^{11}$  (2),  $1 \cdot 10^{12}$  (3),  $2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$  (4). На вставке — производная  $\partial G/\partial V_g$  для  $N_t = 2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ .

для различных значений  $N_t$ . При  $N_t \geq 10^{12} \text{ см}^{-2}$  на кривых эффекта поля появляется область квазиplateau при  $G \approx 2e^2/h$ , обуславливающая возникновение максимума производной  $dG/dV_g$  при  $G \approx e^2/h$  (вставка к рис. 1). Эти особенности означают, что в режиме промежуточной и слабой инверсии ( $G \leq e^2/h$ ) перевальные области ФП выступают как точечные квантовые контакты. Более того, они свидетельствуют о том, что с повышением  $N_t$  образцы становятся мезоскопическими, а именно, электронный перенос в них преимущественно осуществляется по наиболее низкоомному пути протекания и ограничен самой высокоомной перевальной областью, т.е. одиночным квантовым контактом [13]. Данное обстоятельство не вызывает недоумения, поскольку, как было показано в [7], радиус корреляции перколяционного кластера в условиях экспериментов превышает 10 мкм.

Оценим на этих основаниях характеристики квантового контакта в рамках модели параболического седлового потенциала [14] для  $N_t = 2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$  (амплитуда флуктуаций  $\Delta \approx 50 \text{ мЭВ} \gg kT$  удовлетворяет критерию сильного ФП [2]). Проводимость  $G$  области седлового потенциала

$$\varphi = V_s - m\omega_x^2 x^2/2 + m\omega_y^2 y^2/2 \quad (1)$$

при энергии Ферми  $\varepsilon_F \leq V_s + \hbar\omega_y$  имеет вид

$$G = \frac{2e^2}{h} \left[ 1 + \exp\left(-2\pi \frac{\varepsilon_F - V_s - \hbar\omega_y/2}{\hbar\omega_x}\right) \right]^{-1}. \quad (2)$$

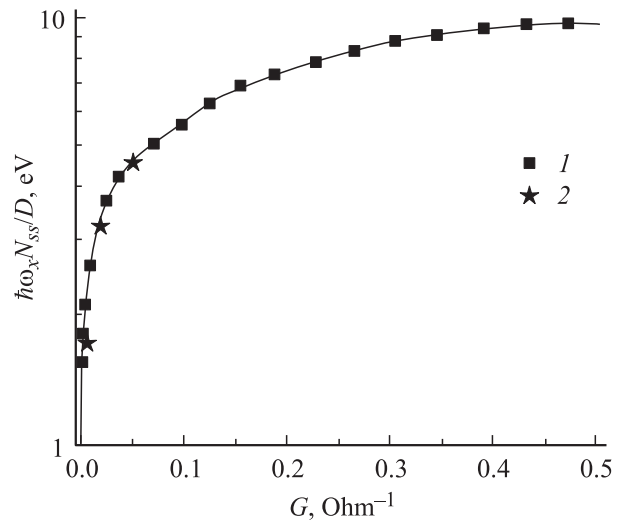
Здесь  $V_s$  — потенциал седловой точки,  $m$  — эффективная масса носителей заряда (дырок),  $\omega_x$  и  $\omega_y$  —

параметры, характеризующие кривизну потенциала в направлении электронного переноса ( $x$ ) и в поперечном направлении ( $y$ ). Перевальные области ФП практически симметричны ( $\omega_x \approx \omega_y$ ) [7], и для образования в них квантовых контактов необходимо выполнение условия  $\hbar\omega_y \leq \Delta$ . Используя зависимость  $G$  от  $\varepsilon_F$  (2), получим оценку параметра  $\hbar\omega_x$  по экспериментальным кривым эффекта поля  $G(V_g)$ . Учитывая, как и в [7], что  $\partial V_g/\partial \varepsilon_F \approx eN_{ss}/C$  ( $C$  — удельная емкость МОП структуры,  $N_{ss}$  — эффективная плотность состояний на границе полупроводник–изолятор,  $N_{ss} \approx m/\pi\hbar^2$  в рассматриваемом диапазоне изменения  $\varepsilon_F$  [2]), получаем выражение

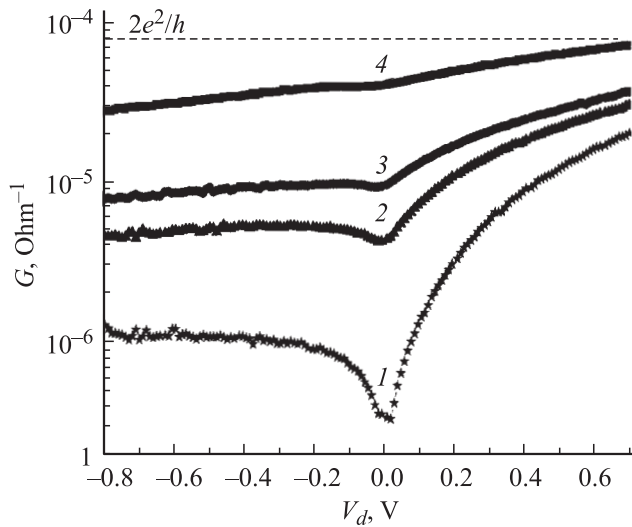
$$\hbar\omega_x = -\frac{2\pi C}{eN_{ss}} \left( \frac{\partial \ln[(2e^2/h)/G - 1]}{\partial V_g} \right)^{-1} \quad (3)$$

для определения  $\hbar\omega_x$  по экспериментальной зависимости  $G(V_g)$ . Следуя [7], по данным эффекта поля можно также получить оценку параметра  $\hbar\omega_y \approx C\Delta V_g/eN_{ss}$ , где  $\Delta V_g = V_g|_{G=e^2/h} - V_g|_{G=(2e^2/h)\exp(-\pi)}$ . В нашем случае, полагая  $N_{ss} \approx D = m/\pi\hbar^2$  (см. [4,7]), имеем  $\hbar\omega_y \approx 20 \text{ мЭВ}$ .

На рис. 2 показан параметр  $\hbar\omega_x$  как функция  $G$ . В области  $G \sim e^2/h$  величина  $\hbar\omega_x \approx 10 \text{ мЭВ}$ , практически постоянна и согласуется с оценкой  $\hbar\omega_x \sim \hbar\omega_y \sim \pi N_t \hbar^2/2m \approx 15 \text{ мЭВ}$  для  $N_t = 2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ . С уменьшением проводимости (т.е.  $\varepsilon_F$ )  $\hbar\omega_x$  спадает, что типично для МДП структур и, по-видимому, обусловлено отклонением распределения потенциала седловой области от параболического закона [8] или спадом  $N_{ss}$  в „хвосте“ плотности состояний [2,11]. При этом выполняются неравенства  $\Delta > \hbar\omega_x$ ,  $\hbar\omega_y > kT$ , подтверждающие возможность возникновения квантовых контактов в перевальных областях ФП и их проявление в эксперименте.



**Рис. 2.** Параметр  $\hbar\omega_x$  в зависимости от проводимости  $G$ , определенной по данным эффекта поля (1) и зависимости  $G(V_g)$  (2).  $N_{ss}$  — эффективная плотность состояний на границе Si–SiO<sub>2</sub>,  $D = m/\pi\hbar^2$  [4,7].



**Рис. 3.** Зависимость проводимости от продольного напряжения для  $V_g = 6.1$  (1), 6.7 (2), 7.1 (3) и 8.9 В (4).  $N_t = 2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ .

Обратимся теперь к зависимости проводимости от продольного напряжения  $V_d$  (рис. 3). На фоне плавного изменения  $G$ , связанного с перераспределением дырок по длине канала [9,11], экспериментальные кривые, соответствующие  $G \ll e^2/h$ , обнаруживают минимум в диапазоне  $|V_d| \leq 100$  мВ при  $V_d \approx 0$ . Минимум обусловлен увеличением туннельной прозрачности седловой области в продольном электрическом поле, а его наличие подтверждает модель электронного переноса, ограниченного точечным квантовым контактом. Согласно [15], зависимость проводимости от продольного напряжения в области минимума имеет вид

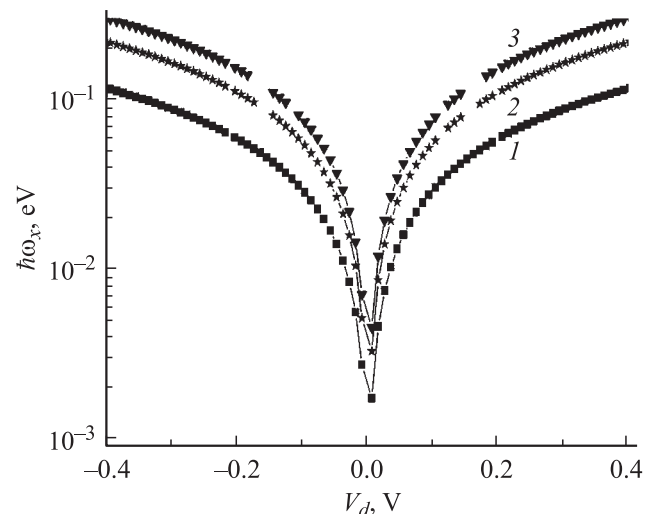
$$G = G_0 \left[ \exp\left(\frac{\pi V_d}{\hbar\omega_x}\right) \left(1 - \frac{V_d}{4(V_s + \hbar\omega_y/2)}\right) + \exp\left(-\frac{\pi V_d}{\hbar\omega_x}\right) \left(1 + \frac{V_d}{4(V_s + \hbar\omega_y/2)}\right) \right], \quad (4)$$

что позволяет дополнительно получить оценку параметра  $\hbar\omega_x$ . (В (4)  $G_0$  — проводимость при  $V_d = 0$ , определяемая (2)). Значения  $\hbar\omega_x$ , определенные для  $V_d = 0$ , (рис. 4) совпадают с результатами, полученными из данных эффекта поля (рис. 2). Иными словами, при малых  $V_d$  результаты анализа зависимостей  $G$  от продольного и поперечного напряжений согласуются в рамках рассматриваемой модели. Между тем с увеличением  $|V_d|$   $\hbar\omega_x$  возрастает до величин  $\sim 300$  мэВ, существенно превышающих амплитуду ФП  $\Delta \approx 50$  мэВ, что противоречит образованию квантовых контактов в перевальных областях ФП.

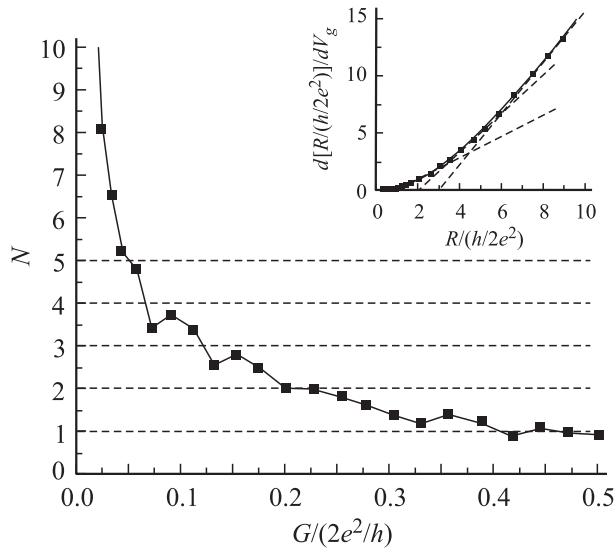
Будем связывать данное противоречие с проявлением микроскопической структуры пути протекания. Действительно, путь формируется потенциальными ямами, последовательно объединенными точечными квантовыми контактами. Эти контакты различаются зна-

чениями потенциала  $V_s$  (1), представляющего собой случайную функцию с дисперсией  $\sim \Delta$ . Характерный размер ям определяется радиусом электронного экранирования  $R_s$  [2], что дает оценку числа квантовых контактов на пути протекания  $N \sim L/R_s$ . При малой концентрации носителей заряда (дырок) в инверсионном канале  $R_s \leq 2d$ , откуда  $N \geq 25$ . Как было показано выше, исследуемые образцы являются мезоскопическими ( $L \leq L_c$ ). Это означает, что при малых  $V_d$  сопротивление пути протекания определяется критическим контактом с наибольшим значением  $V_s$ , тогда как остальные контакты имеют существенно более низкое сопротивление в меру величины  $\exp(-2\pi\Delta/\hbar\omega_x) \ll 1$ . Малое продольное напряжение, падая в основном на самом высокоомном контакте, снижает  $V_s$  на величину  $\sim V_d/2$  [15], что приводит к снижению сопротивления контакта (см. (4)). По этой причине происходит перераспределение продольного напряжения между контактами, число которых  $N$  возрастает с  $|V_d|$  от 1 до  $\sim L/R_s$  при  $|V_d| \geq \Delta$ . Данное обстоятельство и приводит к наблюдаемому возрастанию  $\hbar\omega_x$  в  $N$  раз по отношению к его значению при  $V_d = 0$  (рис. 4). Свойство случайных систем нелинейных контактов гомогенизироваться в продольном электрическом поле в целом известно и обсуждалось, например, в [16].

Рассмотрим проявление нелинейности квантовых контактов в эксперименте по эффекту поля. Обращаясь к рис. 1 (кривая 4), отметим две области, соответствующие различному характеру электронного переноса. В первой из них, при  $G \leq e^2/h$ , преобладает туннелирование носителей заряда (дырок) через точечный квантовый контакт, тогда как во второй области основной вклад в проводимость вносят свободные дырки, о чем, например, свидетельствует возникновение эффекта Холла при  $G \geq e^2/h$  [7]. Такое пороговое поведение проводимости естественно связывать с тем, что кванто-



**Рис. 4.** Параметр  $\hbar\omega_x$  в зависимости от продольного напряжения для  $V_g = 6.1$  (1), 6.7 (2) и 7.1 В (3).



**Рис. 5.** Число квантовых контактов  $N$  в зависимости от  $G$  в режиме эффекта поля для  $N_t = 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ . На вставке — производная  $\partial R/\partial V_g$  как функция  $R$ .

вый контакт [3] проявляется лишь при энергиях ниже или вблизи положения седловой точки  $V_s$ , тогда как при  $\varepsilon \geq V_s + \Delta$  носители заряда оказываются в области квазинепрерывного спектра [2].

Энергия Ферми, изменяющаяся при эффекте поля, поочередно пересекает пороги  $V_{si}$  перехода перевальных областей ФП от одного режима проводимости к другому. В этой ситуации ожидается изменение числа  $N$  квантовых контактов на пути протекания, приводящее к особенностям поведения суммарного сопротивления системы

$$R = \left(\frac{2e^2}{h}\right)^{-1} \left[ N + \sum_{i=1}^N \exp\left(-2\pi \frac{\varepsilon_F - V_{si} - \hbar\omega_y/2}{\hbar\omega_x}\right) \right]. \quad (5)$$

Действительно, производная экспериментальной зависимости  $R(V_g)$ ,

$$\frac{\partial R}{\partial V_g} \propto \frac{\partial R}{\partial \varepsilon_F} = -\frac{2\pi}{\hbar\omega_x} (R - Nh/2e^2), \quad (6)$$

как ожидается, представляет собой линейную функцию  $R$ , а результат ее экстраполяции к значению  $R = 0$  определяет величину  $N$  (см. вставку к рис. 5). Изменение  $N$  в режиме эффекта поля иллюстрирует рис. 5. Как видно,  $N = 1$  при  $G \approx e^2/h$  и возрастает с уменьшением  $G$  до значений  $> 10$ , что качественно согласуется с результатом анализа зависимости  $G$  от  $V_d$ .

Отметим в заключение, что обнаруженные особенности полевых зависимостей проводимости могут иметь и иную природу — например, быть связанными с эффектами когерентного рассеяния носителей заряда в квантовых точках [17], образуемых близко расположенными (соседними) седловыми областями ФП. Эта ситуация,

предполагающая, что соседние седловые области имеют близкие значения  $V_s$ , представляется невозможной в нашем случае. Действительно, следуя [2], нетрудно убедиться в том, что соседние седловые области ФП различаются по  $V_s$  на величину  $\delta V_s \geq \Delta$ , существенно превышающую значения параметра  $\hbar\omega_x/2\pi$ , ответственного за их сопротивление (5). По этой причине квантовые контакты как критические резистивные элементы перколяционных путей образуются одиночными перевальными областями ФП, удаленными друг от друга на расстояние не менее чем  $\sim R_s$ .

Таким образом, обнаруженная нелинейность системы точечных квантовых контактов определяет поведение структур во внешнем продольном и поперечном электрическом поле, что может оказаться существенным при анализе ступеней квантования проводимости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (06-02-17529-а), МНТЦ (2503), программы РАН „Низко-размерные квантовые структуры“ и РНП (2.1.4639).

Авторы признательны В.А. Сабликову за дискуссии.

## Список литературы

- [1] М. Шур. *Современные приборы на основе арсенида галлия* (М., Мир, 1991). [Пер. с англ.: M. Shur. *GaAs Devices and Circuits* (Plenum Press, N.Y.–London, 1987)].
- [2] В.А. Гергель, Р.А. Сурис. *ЖЭТФ*, **84**, 719 (1983).
- [3] Y. Meir. *Phys. Rev. Lett.*, **83**, 3506 (1999).
- [4] Й. Имри. *Введение в мезоскопическую физику* (М., Физматлит, 2002). [Пер. с англ.: Y. Imry. *Introduction to Mesoscopic Physics* (Oxford, University Press, 2002)].
- [5] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. *Электронные свойства легированных полупроводников* (М., Наука, 1979).
- [6] A.I. Yakimov, N.P. Stepina, A.V. Dvurechenskii. *Phys. Low-Dim. Structur.*, **6**, 75 (1994).
- [7] Б.А. Аронзон, Д.А. Бакаушин, А.С. Веденеев, А.Б. Давыдов, Е.З. Мейлихов, Н.К. Чумаков. *ФТП*, **35**, 448 (2001).
- [8] А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон, Д.А. Бакаушин, А.С. Веденеев. *ФТП*, **36**, 1241 (2002).
- [9] С. Зи. *Физика полупроводниковых приборов* (М., Мир, 1984). [Пер. с англ.: S.M. Sze. *Physics of Semiconductor Devices* (J. Willey & Sons, N.Y., 1981)].
- [10] E.N. Nicollian, J.R. Brews. *MOS Physics and Technology* (N.Y., Willey, 1982).
- [11] Т. Андо, А. Фаулер, Ф. Стерн. *Электронные свойства двумерных систем* (М., Мир, 1985). [Пер. с англ.: T. Ando, A. Fowler, and F. Stern. *Rev. Mod. Phys.*, **54**, 437 (1982)].
- [12] A.B. Fowler, A. Harstein. *Phil. Mag. B*, **42**, 949 (1980).
- [13] E.Z. Meilikhov. *Cond-matt/0505409*. <http://arxiv.org>
- [14] M. Buttiker. *Phys. Rev. B*, **41**, 906 (1990).
- [15] T. Ouchterlony, K.-F. Berggren. *Phys. Rev. B*, **52**, 16 329 (1995).
- [16] Б.И. Шкловский. *ФТП*, **13**, 93 (1979).
- [17] В.А. Ткаченко, О.А. Ткаченко, З.Д. Квон, Д.Г. Бакшеев, А.Л. Асеев, Ж.К. Портал. *Письма ЖЭТФ*, **80**, 688 (2004).

Редактор Л.В. Шаронова

## Point quantum contacts in disordered Si-MOS structures with an inversion *p*-channel: the system nonlinear behavior in longitudinal and transverse electric field

A.S. Vedenev, M.A. Feklisov

Institute of Radioengineering and Electronics,  
Russian Academy of Sciences,  
141190 Fryazino, Russia

**Abstract** The conductance  $G$  behavior of the mesoscopic Si-MOS structures with the inversion *p*-channel and increased built-in charge (the ion charge) concentration ( $N_t \leq 3 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-2}$ ) is being discussed under the metal-insulator percolation transition. At temperatures  $\geq 77 \text{ K}$  for the  $G$  dependence on transverse, the  $V_g$ , and longitudinal, the  $V_d$ , voltage the quasi-plateau of the  $G(V_g)$  at  $G \approx e^2/h$  and minimum of the  $G(V_d)$  at  $|V_d| \leq 100 \text{ mV}$  ( $G \ll e^2/h$ ) have been revealed. Calculated point quantum contact characteristic energies,  $\hbar\omega_x \approx \hbar\omega_y \approx 10 \text{ meV}$ , have been shown to be in agreement with results of the field effect data analysis but in contrast to the  $\hbar\omega_x \approx 300 \text{ meV}$  determined with the  $G(V_d)$  dependence. The difference is delivered to the quantum contact system nonlinearity regarding to the longitudinal and transverse electric field. A number of contacts along the percolation path was found to be changed in the electric field,  $1 \leq N \leq 30$ .